【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年3月28日(2024.3.28)

【国際公開番号】WO2023/276002
【出願番号】特願2023-531203(P2023-531203)
【国際特許分類】
H01L 21/66(2006.01)
G01R 31/28(2006.01)
【FI】
H01L 21/66 B
G01R 31/28 K

【手続補正書】
【提出日】令和5年12月27日(2023.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
Ｓ７０６：
ステージ制御部１６５は、検出器信号処理部１６２が出力するＳＥＭ像を確認しながら、プローブユニット制御器１４４を制御し、プローブ１４１を降下させ、目標の測定対象構造物８０１に接触したかを判定する。接触していれば、プローブ触針プロセスＳ７００は終了し、接触していなければ、ステップＳ７０５を再度実行する。